

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002877

International filing date: 23 February 2005 (23.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-053656
Filing date: 27 February 2004 (27.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

28.02.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2004年 2月27日

出願番号
Application Number: 特願2004-053656

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

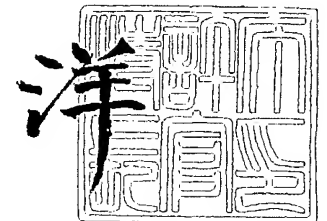
JP2004-053656

出願人
Applicant(s): シャープ株式会社

2005年 4月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 193314
【提出日】 平成16年 2月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 F24C 1/00
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内
 【氏名】 安藤 有司
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内
 【氏名】 上田 真也
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内
 【氏名】 松林 一之
【特許出願人】
 【識別番号】 000005049
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号
 【氏名又は名称】 シャープ株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100084146
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 山崎 宏
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【選任した代理人】
 【識別番号】 100100170
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 前田 厚司
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【選任した代理人】
 【識別番号】 100122286
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 仲倉 幸典
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 204815
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0208766

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

蒸気を発生する蒸気発生装置と、
上記蒸気発生装置からの蒸気を昇温する蒸気昇温装置と、
天井側に天井蒸気吹出口が設けられ、上記蒸気昇温装置から上記天井蒸気吹出口を介して供給される蒸気によって被加熱物を加熱するための加熱室とを備え、
上記蒸気昇温装置は、
上記蒸気発生装置からの蒸気が流入する蒸気供給口が側壁に設けられた凹部を有し、上記加熱室の天井蒸気吹出口上に上記凹部の開口を下側に向けて配置された皿形ケースと、
上記皿形ケースの凹部に配置されたヒータとを含み、
上記皿形ケースの凹部の上記蒸気供給口が設けられた側壁に隣接する両側壁かつその両側壁の上記蒸気供給口と反対の側に、上記加熱室内に側方から蒸気を供給するための複数の蒸気吹出口を設けたことを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の蒸気調理器において、
上記皿形ケースの凹部の平面形状は、上記蒸気供給口から流入する蒸気の流れの中心線に対して略対称であって、
上記ヒータは、平面形状が上記中心線に対して略対称になるように上記皿形ケースの凹部に配置されていることを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の蒸気調理器において、
上記皿形ケースの凹部の上記蒸気供給口と反対の側の側壁が、上記中心線に略直角な平面に対して傾斜していることを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 つに記載の蒸気調理器において、
上記皿形ケースの凹部の平面形状は、コの字形状をなす 3 辺と、その 3 辺の両端に連なり外側に向かって屈曲するくの字形状をなす 2 辺とを有する略 5 角形であって、
上記皿形ケースの凹部の上記コの字形状をなす 3 辺のうちの中央の辺の側壁に、上記蒸気供給口を設けていることを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 つに記載の蒸気調理器において、
上記皿形ケースの凹部の平面形状は、コの字形状をなす 3 辺と、その 3 辺の両端に連なり外側に向かって湾曲する円弧状の外周縁とを有する形であって、
上記皿形ケースの凹部の上記コの字形状をなす 3 辺のうちの中央の辺の側壁に、上記蒸気供給口を設けていることを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 つに記載の蒸気調理器において、
上記皿形ケースの凹部のコーナー部に、隣り合う側壁同士がなだらかに連なるように湾曲面を設けたことを特徴とする蒸気調理器。

【書類名】明細書

【発明の名称】蒸気調理器

【技術分野】

【0001】

この発明は、蒸気調理器に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、蒸気を用いて食品などの被加熱物の加熱調理を行う蒸気調理器として、オープン庫内に過熱蒸気を送り込むものがある(例えば、特許文献1(特開平8-49854号公報)参照)。この蒸気調理器は、ポット内にヒータを設けて蒸気を発生させる蒸気発生装置と、その蒸気発生装置により発生させた蒸気を加熱することにより過熱蒸気を生成する蒸気過熱器とを備え、蒸気過熱器で生成された過熱蒸気をオープン庫内に送り込んで食品を調理する。

【0003】

ところで、上記従来の蒸気調理器では、蒸気過熱器で生成された過熱蒸気をオープン庫の側面上部に設けられた吹出口からオープン庫内に吹き込み、側面下部に設けられた吸込口から吸い込んで、オープン庫内と循環風路を循環する。このため、上記従来の蒸気調理器では、オープン庫内の気流が偏り、温度分布が均一にならないために被加熱物に加熱ムラができ、仕上がりにより調理ができないという問題がある。

【特許文献1】特開平8-49854号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

そこで、この発明の目的は、加熱室内の温度分布を均一にでき、加熱ムラのない調理ができる蒸気調理器を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記目的を達成するため、この発明の蒸気調理器は、蒸気を発生する蒸気発生装置と、上記蒸気発生装置からの蒸気を昇温する蒸気昇温装置と、天井側に天井蒸気吹出口が設けられ、上記蒸気昇温装置から上記天井蒸気吹出口を介して供給される蒸気によって被加熱物を加熱するための加熱室とを備え、上記蒸気昇温装置は、上記蒸気発生装置からの蒸気が流入する蒸気供給口が側壁に設けられた凹部を有し、上記加熱室の天井蒸気吹出口上に上記凹部の開口を下側に向けて配置された皿形ケースと、上記皿形ケースの凹部に配置されたヒータとを含み、上記皿形ケースの凹部の上記蒸気供給口が設けられた側壁に隣接する両側壁かつその両側壁の上記蒸気供給口と反対の側に、上記加熱室内に側方から蒸気を供給するための複数の蒸気吹出口を設けたことを特徴とする。ここで、「蒸気供給口と反対の側」とは、図7で示すように、蒸気供給口が設けられた側壁に隣接する両側壁において、蒸気供給口から遠い位置のことである。

【0006】

上記構成の蒸気調理器によれば、上記蒸気発生装置により発生させた蒸気を蒸気昇温装置により昇温して過熱蒸気とし、その過熱蒸気を加熱室内に供給することにより加熱室内の被加熱物を加熱する。このとき、上記加熱室の天井蒸気吹出口上に配置された蒸気昇温装置の皿形ケースの側壁に設けられた蒸気供給口から、蒸気発生装置の蒸気が流入する。そして、上記蒸気供給口から皿形ケースの凹部に流入した蒸気は、凹部の蒸気供給口と反対の側の側壁におつかった後に左右に分かれ、分かれた蒸気の一部は、凹部の側面に沿って蒸気供給口側に戻って蒸気供給口から流入する蒸気と合流する。そうして、上記皿形ケースの凹部に満たされた蒸気が、凹部の開口側の上記加熱室の天井蒸気吹出口を介して加熱室内に供給される。

【0007】

さらに、上記皿形ケースの凹部の上記蒸気供給口が設けられた側壁に隣接する両側壁か

つその両側壁の上記蒸気供給口と反対の側に設けられた複数の蒸気吹出口を介して、凹部内の蒸気の一部を加熱室内に側方から蒸気を供給することによって、凹部内から複数の蒸気吹出口を介して両側外向に向かって吹き出す蒸気の温度分布を均一にできるので、上記加熱室内に側方から供給される蒸気の温度分布の偏りを低減できる。さらに、上記凹部内では最も流速が速くかつ高温(ヒータ加熱による)の蒸気が上記複数の蒸気吹出口から吹き出すことになるので、加熱室内に勢いよく高温の蒸気が供給される。それにより、加熱室内の蒸気が攪拌されるので、加熱ムラを解消するのにより好適である。したがって、加熱室内の温度分布を均一にでき、加熱ムラのない調理ができる。

【0008】

また、一実施形態の蒸気調理器は、上記皿形ケースの凹部の平面形状は、上記蒸気供給口から流入する蒸気の流れの中心線に対して略対称であって、上記ヒータは、平面形状が上記中心線に対して略対称になるように上記皿形ケースの凹部に配置されていることを特徴とする。

【0009】

上記実施形態の蒸気調理器によれば、上記皿形ケースの凹部の平面形状およびその凹部に配置されたヒータの平面形状を、上記蒸気供給口から流入する蒸気の流れの中心線に対して略線対称にすることによって、凹部内の蒸気の流れに偏りができず、加熱室内に供給される蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0010】

また、一実施形態の蒸気調理器は、上記皿形ケースの凹部の上記蒸気供給口と反対の側の側壁が、上記中心線に略直角な平面に対して傾斜していることを特徴とする。

【0011】

上記実施形態の蒸気調理器によれば、上記皿形ケースの凹部の上記蒸気供給口と反対の側の側壁が、上記蒸気供給口から流入する蒸気の流れの中心線に略直角な平面に対して傾斜しているので、凹部に流入した蒸気が、凹部の蒸気供給口と反対の側の側壁にぶつかって分かれるときに、蒸気の流れをスムーズにして、温度分布ムラを生じさせる蒸気溜り等の発生を抑制して、凹部内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0012】

また、一実施形態の蒸気調理器は、上記皿形ケースの凹部の平面形状が、コの字形状をなす3辺と、その3辺の両端に連なり外側に向かって屈曲するくの字形状をなす2辺とを有する略5角形であって、上記皿形ケースの凹部の上記コの字形状をなす3辺のうちの中央の辺の側壁に、上記蒸気供給口を設けていることを特徴とする。

【0013】

上記実施形態の蒸気調理器によれば、上記皿形ケースの平面形状が略5角形の凹部において、コの字形状をなす3辺の両端に連なり外側に向かって屈曲するくの字形状をなす2辺が、上記中心線に略直角な平面に対して傾斜する壁面となる。これにより、上記凹部のコの字形状をなす3辺のうちの中央の辺の側壁に設けられた蒸気供給口から凹部に流入した蒸気が、上記蒸気供給口と反対の側の上記くの字形状をなす2辺の側壁にぶつかって左右に分かれるときに、蒸気の流れをスムーズにして、温度分布ムラを生じさせる蒸気溜り等の発生を抑制して、凹部内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0014】

また、一実施形態の蒸気調理器は、上記皿形ケースの凹部の平面形状が、コの字形状をなす3辺と、その3辺の両端に連なり外側に向かって湾曲する円弧状の外周縁とを有する形であって、上記皿形ケースの凹部の上記コの字形状をなす3辺のうちの中央の辺の側壁に、上記蒸気供給口を設けていることを特徴とする。

【0015】

上記実施形態の蒸気調理器によれば、上記皿形ケースの凹部において、コの字形状をなす3辺の両端に連なり外側に向かって湾曲する円弧状の外周縁が、上記中心線に略直角な平面に対して傾斜する壁面となる。これにより、上記凹部のコの字形状をなす3辺のうちの中央の辺の側壁に設けられた蒸気供給口から凹部に流入した蒸気が、上記蒸気供給口

と反対の側の上記円弧状の外周縁である側壁にぶつかって左右に分かれるときに、蒸気の流れをスムーズにして、温度分布ムラを生じさせる蒸気溜り等の発生を抑制して、凹部内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0016】

また、一実施形態の蒸気調理器は、上記皿形ケースの凹部のコーナー部に、隣り合う側壁同士がなだらかに連なるように湾曲面を設けたことを特徴とする。

【0017】

上記実施形態の蒸気調理器によれば、上記皿形ケースの凹部のコーナー部に、隣り合う側壁同士がなだらかに連なるように湾曲面を設けることによって、皿形ケースの凹部内に流入した蒸気の一部が凹部の側面に沿ってスムーズに流れる。したがって、凹部内の蒸気の流れが安定し、凹部内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【発明の効果】

【0018】

以上より明らかなように、この発明の蒸気調理器によれば、加熱室内の温度分布を均一にでき、加熱ムラのない調理ができる蒸気調理器を実現することにある。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下、この発明の蒸気調理器を図示の実施の形態により詳細に説明する。

【0020】

図1はこの発明の実施の一形態の蒸気調理器1の外観斜視図であり、直方体形状のキャビネット10の正面の上部に操作パネル11を設け、上記キャビネット10の正面の操作パネル11の下側に、下端側の辺を中心に回動する扉12を設けている。上記扉12の上部にハンドル13を設け、上記扉12に耐熱ガラス製の窓14を設けている。

【0021】

また、図2は上記蒸気調理器1の扉12を開いた状態の外観斜視図を示しており、上記キャビネット10内に直方体形状の加熱室20が設けられている。上記加熱室20は、扉12に面する正面側に開口部20aを有し、加熱室20の側面、底面および天面をステンレス鋼板で形成している。また、上記扉12は、加熱室20に面する側をステンレス鋼板で形成している。上記加熱室20の周囲および扉12の内側に断熱材(図示せず)を配置して、加熱室20内と外部とを断熱している。

【0022】

また、上記加熱室20の底面に、ステンレス製の受皿21が置かれ、受皿21上に被加熱物を載置するためのステンレス鋼線製のラック24(図3に示す)が置かれる。さらに、上記加熱室20の両側面に、長手方向が略水平の略長形状の側面蒸気吹出口22(図2では一方のみを示す)を設けている。

【0023】

図3は上記蒸気調理器1の基本構成を示す概略構成図を示している。図3に示すように、上記蒸気調理器1は、加熱室20と、蒸気用の水を貯める水タンク30と、上記水タンク30から供給された水を蒸発させる蒸気発生装置40と、上記蒸気発生装置40からの蒸気を加熱する蒸気昇温装置50と、上記蒸気発生装置40や蒸気昇温装置50などを制御する制御装置80とを備える。

【0024】

上記加熱室20内に置かれた受皿21上に格子状のラック24を載置し、そのラック24の略中央に被加熱物90が置かれる。

【0025】

また、水タンク30の下側に設けられた接続部30aを、第1給水パイプ31の一端に設けられた漏斗形状の受入口31aに接続している。上記第1給水パイプ31から分岐して上方に延びる第2給水パイプ32の他端にポンプ35の吸込側を接続し、そのポンプ35の吐出側に第3給水パイプ33の一端を接続している。また、上記第1給水パイプ31から分岐して上方に延びる水位センサ用パイプ38の上端に水タンク用水位センサ36を

配設している。さらに、上記第1給水パイプ31から分岐して上方に延びる大気開放用パイプ37の上端を後述する排気ダクト65に接続している。

【0026】

そして、上記第3給水パイプ33は、垂直に配置された部分から略水平に屈曲するL字形状をしており、第3給水パイプ33の他端に補助タンク39を接続している。上記補助タンク39の下端に第4給水パイプ34の一端を接続し、その第4給水パイプ34の他端を蒸気発生装置40の下端に接続している。また、上記蒸気発生装置40の第4給水パイプ34が接続された下端に、排水バルブ70の一端を接続している。そして、排水バルブ70の他端に排水パイプ71の一端を接続し、排水パイプ71の他端に排水タンク72を接続している。なお、上記補助タンク39の上部は、大気開放用パイプ37と排気ダクト65を介して大気に連通している。

【0027】

上記水タンク30が接続されると、水タンク30内の水は、水タンク30と同水位になるまで大気開放用パイプ37内に水が上昇する。上記水タンク用水位センサ36につながる水位センサ用パイプ38は先端が密閉されているため、水位は上がらないが、水タンク30の水位に応じて水位センサ用パイプ38の密閉された空間の圧力は大気圧から上昇する。この圧力変化を、水タンク用水位センサ36内の圧力検出素子(図示せず)により検出することにより、水タンク30内の水位が検出される。ポンプ35の静止中の水位測定では、大気開放用パイプ37は不要であるが、ポンプ35の吸引圧力が直接圧力検出素子に働いて水タンク30の水位検出の精度が低下するのを防止するため、開放端を有する大気開放用パイプ37を用いている。

【0028】

また、上記蒸気発生装置40は、下側に第4給水パイプ34の他端が接続されたポット41と、上記ポット41内の底面近傍に配置されたヒータ42と、上記ポット41内のヒータ42の上側近傍に配置された水位センサ43と、上記ポット41の上側に取り付けられた蒸気吸引エジェクタ44とを有している。そして、加熱室20の側面上部に設けられた吸込口25の外側にファンケーシング26を配置している。上記ファンケーシング26に配置された送風ファン28により、加熱室20内の蒸気は、吸込口25から吸い込まれる。吸い込まれた蒸気は、第1パイプ61と第2パイプ62を介して蒸気発生装置40の蒸気吸引エジェクタ44の入口側に送り込まれる。上記第1パイプ61は、略水平に配置されており、一端がファンケーシング26に接続されている。また、上記第2パイプ62は、略垂直に配置されており、一端が第1パイプ61の他端に接続され、他端が蒸気吸引エジェクタ44のインナーノズル45の入口側に接続されている。

【0029】

上記蒸気吸引エジェクタ44は、インナーノズル45の外側を包み込むアウターノズル46を備えており、インナーノズル45の吐出側がポット41の内部空間と連通している。そして、上記蒸気吸引エジェクタ44のアウターノズル46の吐出側を第3パイプ63の一端に接続し、その第3パイプ63の他端に蒸気昇温装置50を接続している。

【0030】

上記ファンケーシング26、第1パイプ61、第2パイプ62、蒸気吸引エジェクタ44、第3パイプ63および蒸気昇温装置50で外部循環路60を形成している。また、上記加熱室20の側面の下側に設けられた放出口27に放出通路64の一端を接続し、放出通路64の他端を排気ダクト65の一端に接続している。上記排気ダクト65の他端に排気口66を設けている。蒸気放出通路64の排気ダクト65側にラジエータ69を外嵌して取り付けられている。そして、上記外部循環路60を形成する第1パイプ61、第2パイプ62との接続部を、排気通路67を介して排気ダクト65に接続している。上記排気通路67の第1、第2パイプ61、62の接続側に、排気通路67を開閉するダンパ68を配置している。

【0031】

また、上記蒸気昇温装置50は、加熱室20の天井側かつ略中央に、開口を下側にして

配置された皿形ケース 51 と、上記皿形ケース 51 内に配置された第 1 蒸気加熱ヒータ 52 と、上記皿形ケース 51 内に配置された第 2 蒸気加熱ヒータ 53 とを有している。上記皿形ケース 51 の底面は、加熱室 20 の天井面に設けられた金属製の天井パネル 54 で形成されている。上記天井パネル 54 には、複数の天井蒸気吹出口 55 を形成している。また、上記天井パネル 54 は、上下両面が塗装などにより暗色に仕上げられている。なお、使用を重ねることにより暗色に変色する金属素材や暗色のセラミック成型品によって天井パネル 54 を形成してもよい。

【0032】

さらに、上記蒸気昇温装置 50 は、加熱室 20 の左右両側に延びる蒸気供給通路 23 (図 3 では一方のみを示す) の一端が夫々接続されている。そして、上記蒸気供給通路 23 の他端は、加熱室 20 の両側面に沿って下方に延び、加熱室 20 の両側面かつ下側に設けられた側面蒸気吹出口 22 に接続されている。

【0033】

次に、図 4、図 5 を用いて上記蒸気発生装置 40 について詳細に説明する。

【0034】

まず、図 4 (a) は上記蒸気発生装置 40 のポット 41 を上方から見た平面図であり、図 4 (b) は上記ポット 41 の側面図である。

【0035】

図 4 (a), (b) に示すように、ポット 41 は、水平面図が略長形状の筒部 41a と、上記筒部 41a の下側に設けられ、中央に向かって徐々に低くなる傾斜面からなる底部 41b と、上記底部 41b の略中央に設けられた給水口 41c とを有している。上記ポット 41 の平面形状は、縦横比が 1 : 2.5 であるが、細長い形状、つまり長形状や楕円形状であればよい。もっとも、長形状の場合の縦横比が $1/2$ であるのが好ましく、 $1/2.5$ であればより好ましく、 $1/3$ 以下であればさらに好ましい。

【0036】

上記ポット 41 内の底部 41b 近傍にヒータ 42 を配置しており、そのヒータ 42 は、U 形状の大管径のシーズヒータである第 1 蒸気発生ヒータ 42A と、その U 形状の第 1 蒸気発生ヒータ 42A の内側に略同一平面上に配置された U 形状の小管径のシーズヒータである第 2 蒸気発生ヒータ 42B で構成されている。上記ヒータ 42 は、ポット 41 の筒部 41a の側壁に沿って近接して配置されており、ヒータ 42 の外縁と筒部 41a の側壁の最短距離は 2 mm ~ 5 mm としている。また、ヒータ 42 の下端は、ポット 41 の底部 41b に近接して配置されており、ヒータ 42 の最下部とポット 41 の底部 41b の最短距離は 2 mm ~ 5 mm としている。

【0037】

この実施の形態では、第 1 蒸気発生ヒータ 42A は 700 W の大管径のシーズヒータを用い、第 2 蒸気発生ヒータ 42B は 300 W の小管径のシーズヒータを用いている。上記第 1 蒸気発生ヒータ 42A は、略半円弧形状の湾曲部 42Aa と、その湾曲部 42Aa の両端から略平行に延びる 2ヶ所の直線部 42Ab, 42Ac とを有している。また、上記第 2 蒸気発生ヒータ 42B は、略半円弧形状の湾曲部 42Ba と、その湾曲部 42Ba の両端から略平行に延びる 2ヶ所の直線部 42Bb, 42Bc とを有している。上記第 1 蒸気発生ヒータ 42A の湾曲部 42Aa は、使用する大管径のシーズヒータにより定まる最小曲率半径 r_1 となっており、第 2 蒸気発生ヒータ 42B の湾曲部 42Ba は、使用する小管径のシーズヒータにより定まる最小曲率半径 r_2 ($< r_1$) となっている。

【0038】

上記ポット 41 内のヒータ 42 の上側近傍かつ第 2 蒸気発生ヒータ 42B の内側の非発熱部 (図 4 (a) の C 領域) 側の側壁に、水位センサ 43 を配置している。また、上記ポット 41 内に水位センサ 43 の周りを囲む断面コの字形状の仕切板 47 を設けている。上記仕切板 47 は、ポット 41 内の側壁とで断面長形状の筒体を形成している。上記仕切板 47 の下端は、ポット 41 の底部 41b より上側かつ第 1、第 2 蒸気発生ヒータ 42A, 42B の最下部よりも下側に位置する。一方、上記仕切板 47 の上端は、ヒータ 42 の最下部

から水位センサ 4 3 の取り付け位置までの高さの 2 倍以上の高さにしている。また、上記ポット 4 1 内の水位センサ 4 3 に対向する側壁に温度センサ 4 8 を配置している。

【0 0 3 9】

上記水位センサ 4 3 は、自己加熱サーミスタであり、水中では、2 0 ℃～1 0 0 ℃の水の温度に応じて 1 0 0 ℃～1 4 0 ℃程度の温度が検出され、空気中では、略 1 4 0 ℃～1 5 0 ℃前後の温度が検出される。そして、温度センサ 4 8 により検出された水の温度に基づいて、水位センサ 4 3 により検出される温度を判定することにより、水の有無すなわち水位センサ 4 3 の取付位置に水があるか否かを判定する。

【0 0 4 0】

また、図 5 (a) は上記蒸気発生装置 4 0 の側面図であり、図 5 (b) は図 5 (a) の V - V 線から見た断面図である。

【0 0 4 1】

図 5 (a), (b) に示すように、内側に第 1, 第 2 蒸気発生ヒータ 4 2 A, 4 2 B が配置されたポット 4 1 の上側開口を覆うように、蒸気吸引エジェクタ 4 4 を取り付けしている。上記蒸気吸引エジェクタ 4 4 のインナーノズル 4 5 の入口 4 5 a から流入した流体(蒸気)は、インナーノズル 4 5 の吐出口 4 5 b から吐出され、アウターノズル 4 6 の吐出口 4 6 a から吐出される。このとき、上記インナーノズル 4 5 の吐出側がポット 4 1 の内部空間と連通しているので、ポット 4 1 内で発生した飽和蒸気は、アウターノズル 4 6 の吐出口 4 6 a 側に引き込まれ、インナーノズル 4 5 の吐出口 4 5 b から吐出された蒸気と共にアウターノズル 4 6 の吐出口 4 6 a から吐出される。すなわち、ポット 4 1 内の水が沸騰して発生した 1 0 0 ℃, 1 気圧の飽和蒸気は、外部循環路 6 0 (図 3 に示す)を通る循環気流に吸引される。上記蒸気吸引エジェクタ 4 4 の構造によって、飽和蒸気は速やかに吸い上げられ、蒸気発生装置 4 0 内に圧力がかからないので、飽和蒸気の放出が妨げられることがない。

【0 0 4 2】

次に、図 6 に示す上記蒸気調理器 1 の制御ブロックについて説明する。

【0 0 4 3】

図 6 に示すように、制御装置 8 0 には、送風ファン 2 8 と、第 1 蒸気加熱ヒータ 5 2 と、第 2 蒸気加熱ヒータ 5 3 と、ダンパ 6 8 と、排水バルブ 7 0 と、第 1 蒸気発生ヒータ 4 2 A と、第 2 蒸気発生ヒータ 4 2 B と、操作パネル 1 1 と、水タンク用水位センサ 3 6 と、水位センサ 4 3 と、加熱室 2 0 (図 3 に示す)内の温度を検出する温度センサ 8 1 と、加熱室 2 0 内の湿度を検出する湿度センサ 8 2 と、ポンプ 3 5 が接続されている。

【0 0 4 4】

上記制御装置 8 0 は、マイクロコンピュータと入出力回路などからなり、水タンク用水位センサ 3 6, 水位センサ 4 3, 温度センサ 8 1 および湿度センサ 8 2 からの検出信号に基づいて、送風ファン 2 8, 第 1 蒸気加熱ヒータ 5 2, 第 2 蒸気加熱ヒータ 5 3, ダンパ 6 8, 排水バルブ 7 0, 第 1 蒸気発生ヒータ 4 2 A, 第 2 蒸気発生ヒータ 4 2 B, 操作パネル 1 1 およびポンプ 3 5 を所定のプログラムに従って制御する。

【0 0 4 5】

上記構成の蒸気調理器 1 において、操作パネル 1 1 中の電源スイッチ(図示せず)が押されて電源がオンし、操作パネル 1 1 の操作により加熱調理の運転を開始する。そうすると、まず、制御装置 8 0 は、排水バルブ 7 0 を閉ざして、ダンパ 6 8 により排気通路 6 7 を閉じた状態でポンプ 3 5 の運転を開始する。上記ポンプ 3 5 により水タンク 3 0 から第 1 ～第 4 給水パイプ 3 1 ～3 4 を介して蒸気発生装置 4 0 のポット 4 1 内に給水される。そして、上記ポット 4 1 内の水位が所定水位に達したことを水位センサ 4 3 が検出すると、ポンプ 3 5 を停止して給水を止める。

【0 0 4 6】

次に、第 1, 第 2 蒸気発生ヒータ 4 2 A, 4 2 B を通電し、ポット 4 1 内に溜まった所定量の水を第 1, 第 2 蒸気発生ヒータ 4 2 A, 4 2 B により加熱する。

【0 0 4 7】

次に、第1、第2蒸気発生ヒータ42A、42Bの通電と同時、または、ポット41内の水の温度が所定温度に達すると、送風ファン28をオンすると共に、蒸気昇温装置50の第1蒸気加熱ヒータ52を通電する。そうすると、送風ファン28は、加熱室20内の空気(蒸気を含む)を吸込口25から吸い込み、外部循環路60に空気(蒸気を含む)を送り出す。上記送風ファン28に遠心ファンを用いているので、プロペラファンに比べて高圧を発生させることができる。さらに、送風ファン28に用いる遠心ファンを直流モータで高速回転させることによって、循環気流の流速を極めて速くすることができる。

【0048】

次に、上記蒸気発生装置40のポット41内の水が沸騰すると、飽和蒸気が発生し、発生した飽和蒸気は、蒸気吸引エジェクタ44のところで外部循環路60を通る循環気流に合流する。上記蒸気吸引エジェクタ44から出た蒸気は、第3パイプ63を介して高速で蒸気昇温装置50に流入する。

【0049】

そして、上記蒸気昇温装置50に流入した蒸気は、第1蒸気加熱ヒータ52により加熱されて略300℃(調理内容により異なる)の過熱蒸気となる。この過熱蒸気の一部は、下側の天井パネル54に設けられた複数の天井蒸気吹出口55から加熱室20内の下方に向かって噴出する。また、過熱蒸気の一部は、蒸気昇温装置50の左右両側に設けられた蒸気供給通路23を介して加熱室20の両側面の側面蒸気吹出口22から噴出する。

【0050】

これにより、上記加熱室20の天井側から噴出した過熱蒸気が中央の被加熱物90側に向かって勢いよく供給されると共に、加熱室20の左右の側面側から噴出した過熱蒸気は、受皿21に衝突した後、被加熱物90の下方から被加熱物90を包むように上昇しながら供給される。それによって、上記加熱室20内において、中央部では吹き下ろし、その外側では上昇するという形の対流が生じる。そして、対流する蒸気は、順次吸込口25に吸い込まれて、外部循環路60を通過して再び加熱室20内に戻るという循環を繰り返す。

【0051】

このようにして上記加熱室20内で過熱蒸気の対流を形成することにより、加熱室20内の温度、湿度分布を均一に維持しつつ、蒸気昇温装置50からの過熱蒸気を天井蒸気吹出口55と側面吹出口22から噴出して、ラック24上に載置された被加熱物90に効率よく衝突させることが可能となる。そうして、過熱蒸気の衝突により被加熱物90を加熱する。このとき、上記被加熱物90の表面に接触した過熱蒸気は、被加熱物90の表面で結露するとき潜熱を放出することによっても被加熱物90を加熱する。これにより、過熱蒸気の大量の熱を確実にかつ速やかに被加熱物90全面に均等に与えることができる。したがって、むらがなく仕上がりよい加熱調理を実現することができる。

【0052】

また、上記加熱調理の運転において、時間が経過すると、加熱室20内の蒸気量が増加し、量的に余剰となった分の蒸気は、放出口27から放出通路64、排気ダクト65を介して排気口66から外部に放出される。このとき、放出通路64に設けたラジエータ69により放出通路64を通過する蒸気を冷却して結露させることによって、外部に蒸気があるまま放出されるのを抑制している。上記ラジエータ69により放出通路64内で結露した水は、放出通路64内を流れ落ちて受皿21に導かれ、調理により発生した水と共に調理終了後に処理する。

【0053】

調理終了後、制御装置80により操作パネル11に調理終了のメッセージを表示し、さらに操作パネル11に設けられたブザー(図示せず)により合図の音を鳴らす。それにより、調理終了を知った使用者が扉12を開けると、制御装置80は、扉12が開いたことをセンサ(図示せず)により検知して、排気通路67のダンパ68を瞬時に開く。それにより、外部循環路60の第1パイプ61が排気通路67を介して排気ダクト65に連通し、加熱室20内の蒸気は、送風ファン28により吸込口25、第1パイプ61、排気通路67および排気ダクト65を介して排気口66から排出される。このダンパ動作は、調理中に使

用者が扉12を開いても同様である。したがって、使用者は、蒸気にさらされることなく、安全に被加熱物90を加熱室20内から取り出すことができる。

【0054】

また、上記蒸気発生装置40のポット41内の底部41b近傍かつ略同一水平面上にヒータ42を配置することによって、ポット41内に供給される水の水位を、ポット41の底部41bからヒータ42の上部のわずか上側までとすることが可能となる。したがって、ポット41内の水位を、ポット41の底部41bからヒータ42の上部のわずか上側までとし、水位を可能な限り低くすることによって、ヒータ42により加熱するポット41内の水量をできるだけ少なくでき、蒸気発生装置40による蒸気発生 of 立ち上がりを早くすることができる。上記蒸気発生装置40による蒸気発生 of 立ち上がりを早くすることにより、過熱蒸気の立ち上がりを早くできて、調理時間を短縮することができる。特に、長時間運転を停止した後の最初の加熱調理時において、停止中に予熱などを行うことなく、加熱室20に供給する過熱蒸気の立ち上がりを早くできるので、調理時間の短縮化の効果が顕著である。

【0055】

また、上記蒸気発生装置40の平面形状が細長い形状(この実施形態では略長方形)のポット41内にヒータ42が配置され、そのヒータ42として用いられるシーズヒータ(42A, 42B)をポット41の側壁に沿うように配置することによって、ヒータ42の外縁で囲まれる領域の占有面積が小さくなり、ポット41内のヒータ占有床面積(または水面の面積)に対するヒータ電力を高くすることができると共に、ポット41の平面形状の面積も小さくすることができる。したがって、上記ポット41内のヒータ占有床面積(または水面の面積)に対するヒータ電力を高くし、さらにポット41の平面形状の面積も小さくして水量を低減することにより、蒸気発生装置40による蒸気の発生をより早く立ち上げることができる。

【0056】

また、上記U字形状の大管径のシーズヒータである第1蒸気発生ヒータ42Aと、その第1蒸気発生ヒータ42Aの内側に略同一水平面上に配置されたU字形状の小管径のシーズヒータである第2蒸気発生ヒータ42Bにおいて、湾曲部42Baの曲率半径を、シーズヒータの管径などにより定まる最小曲率半径にすることによって、ヒータ42への投入電力が同一の条件であれば、径の異なる2種類のシーズヒータで構成されるヒータ42の外縁で囲まれる領域の占有面積を、ポット41内のヒータ占有床面積(または水面の面積)に対するヒータ電力が最も高くなるように小面積化ができる。上記ポット41内のヒータ占有床面積(または水面の面積)に対するヒータ電力を高くすることにより、上記蒸気発生装置による蒸気発生 of 立ち上がりをさらに早くすることができる。また、上記大電力(700W)の第1蒸気発生ヒータ42Aと小電力(300W)の第2蒸気発生ヒータ42Bの通電を制御装置80により切り換えることによって、その組み合わせにより蒸気発生のために投入される電力を制御することが可能となり、調理内容に応じた蒸気発生が可能となる。

【0057】

また、図7(a)は上記蒸気調理器の蒸気昇温装置50を下側から見た平面図を示しており、図7(b)は上記蒸気昇温装置50の蒸気供給口側から見た側面図を示している。上記蒸気昇温装置50は、図7(a), (b)に示すように、平面形状が略五角形の凹部51aを有する皿形ケース51内に、大電力(1000W)の大管径のシーズヒータである第1蒸気加熱ヒータ52と小電力(300W)の小管径のシーズヒータである第2蒸気加熱ヒータ53とを配置している。上記第1蒸気加熱ヒータ52よりも第2蒸気加熱ヒータ53の単位表面積あたりの電力密度が高くなっている。また、図7(a), (b)では示していないが、皿形ケース51の凹部51aの開口は、加熱室20の天井面に設けられた金属製の天井パネル54(図3に示す)で覆われている。

【0058】

上記皿形ケース51の凹部51aは、蒸気供給管94A, 94B, 94Cが接続された第

1側壁91と、その第1側壁91の一方の側にR部105Aを介して隣接し、第1側壁91に対して略直角な第2側壁92Aと、上記第1側壁91の他方の側にR部105Bを介して隣接し、第1側壁91に対して略直角かつ第2側壁92Aに平行な第3側壁92Bと、上記第2側壁92AとR部106Aを介して隣接し、第2側壁92Aに対して鈍角をなす第4側壁93Aと、上記第3側壁92BとR部106Bを介して隣接し、第3側壁92Bに対して鈍角をなしかつ第4側壁93Aに対して鈍角をなす第5側壁93Bとを有している。上記第4側壁93Aと第5側壁93BとはR部107を介して隣接している。上記皿形ケース51は、しぼり加工で形成することにより、凹部51aのコーナー部である湾曲面を有するR部105A, 106A, 106B, 107を設けている。

【0059】

上記皿形ケース51において、蒸気供給管94A, 94B, 94Cが接続された第1側壁91側がこの蒸気調理器1の背面側(図7(a)の右側)であり、第4側壁93A, 第5側壁93B側が蒸気調理器1の前面側(図7(a)の左側)である。上記第1側壁91の略中央に蒸気供給口95Aを有する蒸気供給管94Aを接続し、その蒸気供給管94Aの両側に所定の間隔をあけて蒸気供給口95B, 95Cを有する蒸気供給管94B, 94Cを夫々接続している。また、上記第2側壁92Aの前面側から背面側に向かって、所定の間隔をあけて蒸気吹出口101A, 102A, 103A, 104Aを設けると共に、その蒸気吹出口101A~104Aに対向する第3側壁92Bの位置に、蒸気吹出口101B, 102B, 103B, 104Bを設けている。上記蒸気吹出口101A~104Aおよび蒸気吹出口101B~104Bは、図3に示す蒸気供給通路23に接続されている。また、上記蒸気供給管94A, 94B, 94Cの入口側に、図3に示す第3パイプ63を介して蒸気発生装置40の蒸気吸引エジェクタ44の吐出側を接続している。

【0060】

また、上記第1側壁91の蒸気供給管94A, 94Cの外側に、第1蒸気加熱ヒータ52の第1, 第2非発熱部52b, 52cを貫通して固定している。上記第1蒸気加熱ヒータ52の第1, 第2非発熱部52b, 52cの先端に電気配線(図示せず)が接続される。上記第1蒸気加熱ヒータ52は、蒸気供給口95A, 95B, 95Cから流入する蒸気の流れの中心線Lに対して略線対称な平面形状であって、上記中心線Lに略平行に所定の間隔をあけて配置された2ヶ所の第1, 第2非発熱部52b, 52cと、その第1, 第2非発熱部52b, 52cの先端に一端が夫々接続され、凹部51a中央に向かって湾曲する略U字形状の2ヶ所の第1, 第2発熱部52a-1, 52a-2とその2ヶ所の第1, 第2発熱部52a-1, 52a-2の他端間を接続する略コの字形状の第3発熱部52a-3とを有する。また、上記第1蒸気加熱ヒータ52の第1~第3発熱部52a-1~52a-3の外周および第1, 第2非発熱部52b, 52cの一部の外周に、螺旋状の放熱フィン56を巻きつけている。

【0061】

さらに、上記第1側壁91の蒸気供給管94A, 94Bの間と蒸気供給管94B, 94Cの間に、第2蒸気加熱ヒータ53の両端の非発熱部53b, 53cを貫通して固定している。上記第2蒸気加熱ヒータ53の両端の非発熱部53b, 53cの先端に電気配線(図示せず)が接続される。上記第2蒸気加熱ヒータ53は、発熱部53aが円形をしており、その円形の発熱部53aの両端が非発熱部53b, 53cに連なる形状をしている。上記第2蒸気加熱ヒータ53は、蒸気供給口95A, 95B, 95Cから流入する蒸気の流れの中心線Lに対して略線対称な平面形状である。

【0062】

上記皿形ケース51の凹部51aの蒸気の一部が、上記中心線Lを挟んで対向する第2, 第3側壁92A, 92Bにかつ蒸気供給口95A, 95B, 95Cと反対の側(前面側)に設けられた蒸気吹出口101A~104A, 101B~104Bと蒸気供給通路23(図3に示す)を介して側面蒸気吹出口22A, 22B(図12に示す)から加熱室20内に吹き出す。

【0063】

また、図8(a)は第2蒸気加熱ヒータのない蒸気昇温装置を下側から見た平面図を示し、

ており、図 8 (b) は上記蒸気昇温装置の蒸気供給口側から見た側面図を示している。この蒸気昇温装置 150 は、第 2 蒸気加熱ヒータがないのと第 1 蒸気加熱ヒータの形状を除いて図 7 (a), (b) に示す蒸気昇温装置と同一の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。図 8 (a) において、151 は第 2 蒸気加熱ヒータの取り付け箇所を設けていない皿形ケース、152 は第 1 蒸気加熱ヒータ、105A, 105B, 106A, 106B, 107 は R 部である。

【0064】

次に、上記蒸気昇温装置 50 の蒸気の流れを図 9 (a) を用いて説明する。

【0065】

図 9 (a) に示すように、蒸気発生装置 40 (図 3 に示す) から供給された蒸気は、図面上側(背面側)の蒸気供給口 95A, 95B, 95C を通って図面下側(前面側)に向かって皿形ケース 51 内に流れ込む。そして、例えば蒸気供給口 95B から流入した蒸気の流れ R1 に着目すると、皿形ケース 51 の凹部 51a の R 部 107 近傍で、第 4 側壁 93A 側と第 5 側壁 93B 側に分岐して分岐流 R2A, R2B となる。そして、上記分岐流 R2A の一部は、第 4 側壁 93A に沿って側方に向かって流れ、R 部 106A 近傍で第 2 側壁 92A に沿って流れるように向きを変え、さらに、R 部 105A で内側に向きを変えて再び流れ R1 に合流する。同様に、上記分岐流 R2B の一部は、第 5 側壁 93B に沿って側方に向かって流れ、R 部 106B 近傍で第 3 側壁 92B に沿って流れるように向きを変え、さらに、R 部 105B で内側に向きを変えて再び流れ R1 に合流する。また、他の蒸気供給口 95A, 95C から流入する蒸気についても、蒸気供給口 95B から流入する蒸気の流れ R1 に沿って流れることになる。

【0066】

こうして、皿形ケース 51 の凹部 51a 内の蒸気を第 1, 第 2 蒸気加熱ヒータ 52, 53 で加熱することにより過熱蒸気を生成し、生成された過熱蒸気を天井蒸気吹出口 55 (図 3 に示す) および蒸気吹出口 101A ~ 104A, 101B ~ 104B から吹き出す。

【0067】

上記実施形態の蒸気昇温装置 50 では、皿形ケース 51 の凹部 51a の平面形状を、コの字形状をなす 3 辺と、その 3 辺の両端に連なり外側に向かって屈曲するくの字形状をなす 2 辺とを有する略 5 角形としたが、皿形ケースの凹部の平面形状はこれに限らず、例えば図 9 (b) に示すように、コの字形状をなす 3 辺と、その 3 辺の両端に連なり外側に向かって湾曲する円弧状の外周縁を有する壁面 96 とを有する形状であってもよい。

【0068】

これに対して、例えば、蒸気昇温装置の皿形ケースの形状が図 10 に示すような前面側かつ両側のコーナー部が鋭角である場合、図面上側(背面側)の蒸気供給口 95A, 95B, 95C から図面下側(前面側)に向かって皿形ケース 251 内に流れ込み、例えば蒸気供給口 95B から流入した蒸気の流れ R11 に着目すると、蒸気供給口 95B の反対側で分岐して分岐流 R12A, R12B となる。このとき、鋭角なコーナー部には、蒸気溜り SA, SB ができ、この蒸気溜り SA, SB が原因となって、皿形ケース 251 内の蒸気の温度分布が不均一になってしまう。

【0069】

また、図 11 (a) はこの発明の実施形態の蒸気調理器の蒸気昇温装置の放熱フィンについて説明するための図を示しており、皿形ケース 51 (図 7 (a), (b) に示す) の第 1 側壁 91 近傍における第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 の互いに平行な部分を示している。第 1 蒸気加熱ヒータ 52 に同じ巡回方向で螺旋状の放熱フィン 56 を巻きつけているので、放熱フィン 56 の傾斜面は同じ方向に傾いている。このため、例えば図 11 (a) に示す第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 の互いに平行な部分の中央を図中の上側から下側に向けて流れる蒸気に対して、放熱フィン 56 の傾斜面の影響は異なることになる。しかしながら、この実施の形態では、第 1 蒸気加熱ヒータ 52 に巻回する螺旋状の放熱フィン 56 のフィンピッチを 10 mm とすることによって、蒸気供給口 94A, 94B, 94C (図 9 に示す) から吹き出す蒸気の流れに対する放

熱フィン56の影響度(乱れや抵抗損失)の分布を蒸気の中心線Lに対して略線対称にしている。

【0070】

なお、図11(b)に示すように、図11(a)よりもフィンピッチが広い場合の放熱フィン57を第1蒸気加熱ヒータ52に巻回した場合は、蒸気供給口94A, 94B, 94C(図9に示す)から吹き出す蒸気の流れに対して放熱フィン57の影響が左右で異なってしまい、皿形ケース51の凹部51a内の蒸気の流れが乱れて安定せず、温度分布を均一にできなくなる。

【0071】

また、図12は上記蒸気調理器の扉を開いた状態の正面図を示しており、加熱室20の奥の側面上部の隅に吸込口25が配置され、加熱室20の天井側の略中央に、複数の天井蒸気吹出口55を有する円形の天井パネル54を取り付けている。また、加熱室20の左右の側面の下側に、蒸気昇温装置50からの蒸気が吹き出す側面蒸気吹出口22A, 22Bを配置している。上記加熱室20の左側に水タンク30を配置している。

【0072】

このように、上記構成の蒸気調理器によれば、皿形ケース51の凹部51aの平面形状およびその凹部51a内に配置された第1蒸気加熱ヒータ52の平面形状を、蒸気供給口95A, 95B, 95Cから流入する蒸気の流れの中心線Lに対して略線対称にすることによって、凹部51a内の蒸気の流れに偏りができず、温度分布が均一化され、加熱室20の天井パネル54の天井蒸気吹出口55から加熱室20内に供給される蒸気の温度分布を均一にすることができる。

【0073】

さらに、上記皿形ケース51の凹部51a内に配置された第1蒸気加熱ヒータ52に巻回された螺旋形状の放熱フィン56のフィンピッチを10mm以下とすることによって、蒸気供給口95A, 95B, 95Cから吹き出す蒸気の流れに対する放熱フィン56の影響度(乱れや抵抗損失)の分布を上記中心線Lに対して略線対称に分布させることができ、凹部51a内の蒸気の温度分布がより均一化され、加熱室20の天井パネル54の天井蒸気吹出口55から加熱室20内に供給される蒸気の温度分布を均一にすることができる。したがって、加熱室20内の温度分布を均一にでき、加熱ムラのない調理が行うことができる。

【0074】

また、上記皿形ケース51の凹部51aの中心線Lを挟んで対向する第2, 第3側壁92A, 92Bかつ蒸気供給口95A, 95B, 95Cと反対の側に蒸気吹出口101A~104A, 101B~104Bを設けると共に、その蒸気吹出口101A~104A, 101B~104Bを上記中心線Lに対して略線対称に凹部51a内に配置することによって、凹部51a内から蒸気吹出口101A~104A, 101B~104Bを介して左右の側方に向かって吹き出す蒸気の量や流速および温度の分布を均一にできるので、蒸気供給通路23(図3に示す)を介して加熱室20内に側方から供給する蒸気の温度分布の偏りを低減でき、加熱室20内の温度分布をより均一にできる。

【0075】

なお、上記皿形ケースの凹部の平面形状およびヒータ5の平面形状が略線対称でなくとも、皿形ケースの凹部の蒸気供給口が設けられた側壁に隣接する両側壁かつその両側壁の上記蒸気供給口と反対の側に、加熱室内に側方から蒸気を供給するための複数の蒸気吹出口を設けることにより、凹部内から複数の蒸気吹出口を介して両側外向に向かって吹き出す蒸気の温度分布を均一にすることができる。

【0076】

また、上記皿形ケース51の凹部51aの第4, 第5側壁93A, 93Bが、蒸気供給口95A, 95B, 95Cから流入する蒸気の流れの中心線Lに略直角な平面に対して傾斜しているため、凹部51a内に流入した蒸気が、第4, 第5側壁93A, 93Bにぶつかって左右に分かれるときに、蒸気の流れをスムーズにして、温度分布ムラを生じさせる蒸気溜

り等の発生を抑制して、凹部 51a内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0077】

また、上記皿形ケース 51 の略五角形の凹部 51aにおいて、コの字形状をなす 3 辺の両端に連なり外側に向かって屈曲するくの字形状をなす 2 辺が、上記中心線 L に略直角な平面に対して傾斜する第 4, 第 5 側壁 93A, 93B となる。これにより、上記中心線 L に対して略線対称な平面形状の皿形ケース 51 の凹部 51a内に流入した蒸気が、第 4, 第 5 側壁 93A, 93B にぶつかって左右に分かれるときに、蒸気の流れをスムーズにして、温度分布ムラを生じさせる蒸気溜り等の発生を抑制して、凹部 51a内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0078】

なお、図 9 (b) に示すように、上記皿形ケース 51 の凹部 51aの平面形状を、コの字形状をなす 3 辺と、その 3 辺の両端に連なり外側に向かって湾曲する円弧状の外周縁とを有する形にしてもよい。この場合、湾曲する円弧状の外周縁が上記中心線 L に略直角な平面に対して傾斜する壁面 96 となる。これにより、上記蒸気供給口 95A, 95B, 95C から凹部 51a内に流入した蒸気が、円弧状の外周縁を有する壁面 96 にぶつかって左右に分かれるときに、蒸気の流れをスムーズにして、温度分布ムラを生じさせる蒸気溜り等の発生を抑制して、凹部 51a内を流れる蒸気の温度分布をより均一にできる。

【0079】

さらに、上記皿形ケース 51 の凹部 51aのコーナー部に、隣り合う側壁同士がなだらかに連なるように湾曲面を有する R 部 105A, 105B, 106A, 106B, 107 を設けることによって、凹部 51a内に流入した蒸気が凹部 51aの側面に沿ってスムーズに流れる。したがって、凹部 51a内の蒸気の流れが安定し、凹部 51a内を流れる蒸気の温度分布をより均一にすることができる。

【0080】

また、図 7 (a) に示すように、上記皿形ケース 51 の凹部 51a内に配置された第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1 ～第 3 発熱部 52a-1 ～ 52a-3 および第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c の一部に放熱フィン 56 を巻回することによって、第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 側から第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c 側に伝わる熱を、第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c 側の放熱フィン 56 を介して放熱するので、第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c が過熱により高温になるのを防いで、電気配線が接続される側の第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の非発熱部 52b, 52c の温度上昇を低減でき、高い信頼性を得ることができる。

【0081】

また、上記第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 と第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c との接続部近傍が、蒸気供給口 95A, 95C から流入する蒸気が直接当たる位置に配置されているので、第 1 蒸気加熱ヒータ 52 により昇温された蒸気の温度に比べて低温の蒸気が蒸気供給口 95A, 95C から第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 と第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c との接続部近傍に供給される。したがって、低温の蒸気により第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 から第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c に伝わる熱を、第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c 側の放熱フィン 56 を介して放熱することができ、電気配線が接続される側の非発熱部 52b, 52c の温度上昇を効果的に低減することができる。なお、上記第 1 蒸気加熱ヒータの第 1, 第 2 発熱部と第 1, 第 2 非発熱部との接続部が、蒸気供給口から流入する蒸気が直接当たる位置に配置されていてもよい。

【0082】

また、大電力の第 1 蒸気加熱ヒータ 52 と小電力の第 2 蒸気加熱ヒータ 53 のうち、大電力の第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1 ～第 3 発熱部 52a-1 ～ 52a-3 および第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c の一部に放熱フィン 56 を設けることによって、発熱量の大きい第 1 蒸気加熱ヒータ 52 の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 から第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c に伝わる熱を、第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c 側の放熱フィン 56 を介して放熱する

ことができ、電気配線が接続される側のヒータの非発熱部の温度上昇をより効果的に低減できる。

【0083】

さらに、上記蒸気昇温装置 50 の皿形ケース 51 の凹部 51a 内に、蒸気供給口 95A, 95B, 95C 近傍の空間の単位体積あたりの発熱密度が高くなるように第 1, 第 2 蒸気加熱ヒータ 52, 53 を配置することによって、蒸気供給口 95A, 95B, 95C から流入する低温度の蒸気が単位体積あたりの発熱密度が高い領域の第 1, 第 2 蒸気加熱ヒータ 52, 53 の部分に当たって加熱され、皿形ケース 51 の凹部 51a 内全体の温度分布が均一化されて、加熱室 20 の天井蒸気吹出口 55 から加熱室 20 内に供給される蒸気の温度分布を均一にすることができる。したがって、加熱室 20 内の温度分布を均一にでき、加熱ムラの少ない調理ができる。

【0084】

また、単位表面積あたりの電力密度が異なる第 1, 第 2 蒸気加熱ヒータ 52, 53 のうちの単位表面積あたりの電力密度が高い第 2 蒸気加熱ヒータ 53 を蒸気供給口 95A, 95B, 95C 近傍に配置することによって、蒸気供給口 95A, 95B, 95C から流入する低温度の蒸気が単位表面積あたりの電力密度が高い第 2 蒸気加熱ヒータ 53 により加熱されるので、蒸気の温度上昇の立ち上がりを早くでき、調理時間を短縮化が図れると共に、皿形ケース 51 の凹部 51a 内全体の温度分布をより効果的に均一化できる。

【0085】

また、単位表面積あたりの電力密度が異なりかつ蒸気供給口 95A, 95B, 95C から流入する蒸気の流れの中心線 L に対して略線対称な平面形状をしている第 1, 第 2 蒸気加熱ヒータ 52, 53 のうち、単位表面積あたりの電力密度が高い第 2 蒸気加熱ヒータ 53 を内側に配置し、単位表面積あたりの電力密度が低い第 1 蒸気加熱ヒータ 52 を外側に配置することによって、蒸気供給口 95A, 95B, 95C から流入する低温度の蒸気が、内側に配置された単位表面積あたりの電力密度が高い第 2 蒸気加熱ヒータ 53 により加熱され、その外側では単位表面積あたりの電力密度が低い第 1 蒸気加熱ヒータ 52 により加熱されるので、皿形ケース 51 の凹部 51a 内全体の温度分布をより効果的に均一化できる。

【0086】

また、上記蒸気供給口 95A, 95B, 95C から流入する蒸気の流れの中心線 L に対して略線対称な平面形状をしている第 1, 第 2 蒸気加熱ヒータ 52, 53 を用いることによって、凹部 51a 内の蒸気の流れに左右の偏りができず、皿形ケース 51 の凹部 51a 内全体の温度分布をより効果的に均一化できる。

【0087】

また、上記中心線 L に略平行に所定の間隔をあけて配置された 2ヶ所の第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c と、その第 1, 第 2 非発熱部 52b, 52c の先端に一端が夫々接続され、凹部 51a 中央に向かって湾曲する略 U 字形状の 2ヶ所の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 とその 2ヶ所の第 1, 第 2 発熱部 52a-1, 52a-2 の他端間を接続する略コの字形状の第 3 発熱部 52a-3 とを有する第 1 蒸気加熱ヒータ 52 は、蒸気供給口 95A, 95B, 95C から流入する蒸気の流れの中心線 L に対して略線対称な平面形状をしているので、凹部 51a 内の蒸気の流れに偏りができず、皿形ケース 51 の凹部 51a 内全体の温度分布をより効果的に均一化できる。

【0088】

また、上記実施の形態では、蒸気発生装置 40 において U 字形状の大管径のシーズヒータである第 1 蒸気発生ヒータ 42A と、その内側に配置された U 字形状の小管径のシーズヒータである第 2 蒸気発生ヒータ 42B とを有するヒータ 42 を用いたが、ヒータの形状はこれに限らない。しかしながら、ポット内の底部近傍に配置された略同一水平面上のヒータであるのが好ましい。

【0089】

また、上記実施の形態では、蒸気昇温装置 50 に平面形状のヒータとしての第 1 蒸気加

熱ヒータ 52 (図 7 に示す) を用いたが、ヒータの形状はこれに限らず、蒸気供給口から流入する蒸気の流れの中心線 L に対して略線対称な平面形状であればよい。

【0090】

例えば、図 13 に示すように、皿形ケース 51 の凹部 51a 内に配置されたヒータ 58 であってよい。このヒータ 58 は、直線部 58a と、半円弧形状の湾曲部 58b と、直線部 58c と、半円弧形状の湾曲部 58d と、直線部 58e と、半円弧形状の湾曲部 58f と、直線部 58g とを有している。

【0091】

上記直線部 58a の一端 (非発熱部側) を、皿形ケース 51 の第 1 側壁 91 の一端近傍に挿通し、直線部 58a の他端は、第 2 側壁 92A に略平行に第 4 側壁 93A 近傍まで延びている。上記直線部 58a の他端に半円弧形状の湾曲部 58b の一端を接続し、その湾曲部 58b の他端に、直線部 58a に略平行に第 1 側壁 91 側に延びる直線部 58c の一端を接続している。また、上記直線部 58c の他端に半円弧形状の湾曲部 58d の一端を接続し、その湾曲部 58d の他端に、上記直線部 58c に略平行に第 1 側壁 91 と反対の側に延びる直線部 58e の一端を接続している。上記直線部 58e の他端に半円弧形状の湾曲部 58f の一端を接続し、その湾曲部 58f の他端に、第 3 側壁 92B に略平行に延びる直線部 58g の一端を接続している。その直線部 58g の他端 (非発熱部側) を第 1 側壁 91 の他端近傍に挿通している。上記ヒータ 58 は、蒸気供給口 95A, 95B, 95C からの蒸気の流れの中心線 L に対して略線対称な平面形状をしている。

【図面の簡単な説明】

【0092】

【図 1】 図 1 はこの発明の実施の一形態の蒸気調理器の外観斜視図である。

【図 2】 図 2 は上記蒸気調理器の扉を開いた状態の外観斜視図である。

【図 3】 図 3 は上記蒸気調理器の構成を示す概略構成図である。

【図 4】 図 4 (a) は上記蒸気調理器の蒸気発生装置のポットの水平面図であり、図 4 (b) は上記ポットの側面図である。

【図 5】 図 5 (a) は上記蒸気発生装置 40 の側面図であり、図 5 (b) は図 5 (a) の V-V 線から見た断面図である。

【図 6】 図 6 は上記蒸気調理器の制御ブロック図である。

【図 7】 図 7 (a) は上記蒸気調理器の蒸気昇温装置の下側から見た平面図であり、図 7 (b) は上記蒸気昇温装置の蒸気供給口側から見た側面図である。

【図 8】 図 8 (a) は第 2 蒸気加熱ヒータのない蒸気昇温装置の下側から見た平面図であり、図 8 (b) は上記蒸気昇温装置の蒸気供給口側から見た側面図である。

【図 9】 図 9 (a) は上記蒸気昇温装置の蒸気の流れを示す模式図である。図 9 (b) は上記蒸気昇温装置の皿形ケースの他の例を示す模式図である。

【図 10】 図 10 は他の蒸気昇温装置の蒸気の流れを示す模式図である。

【図 11】 図 11 (a) はこの発明の実施形態の蒸気調理器の蒸気昇温装置の放熱フィンを説明するための図であり、図 11 (b) は図 11 (a) よりもピッチが広い場合の放熱フィンを説明するための図である。

【図 12】 図 12 は上記蒸気調理器の扉を開いた状態の正面図である。

【図 13】 図 13 は上記蒸気調理器の蒸気昇温装置に用いられるヒータの他の例を説明するための図である。

【符号の説明】

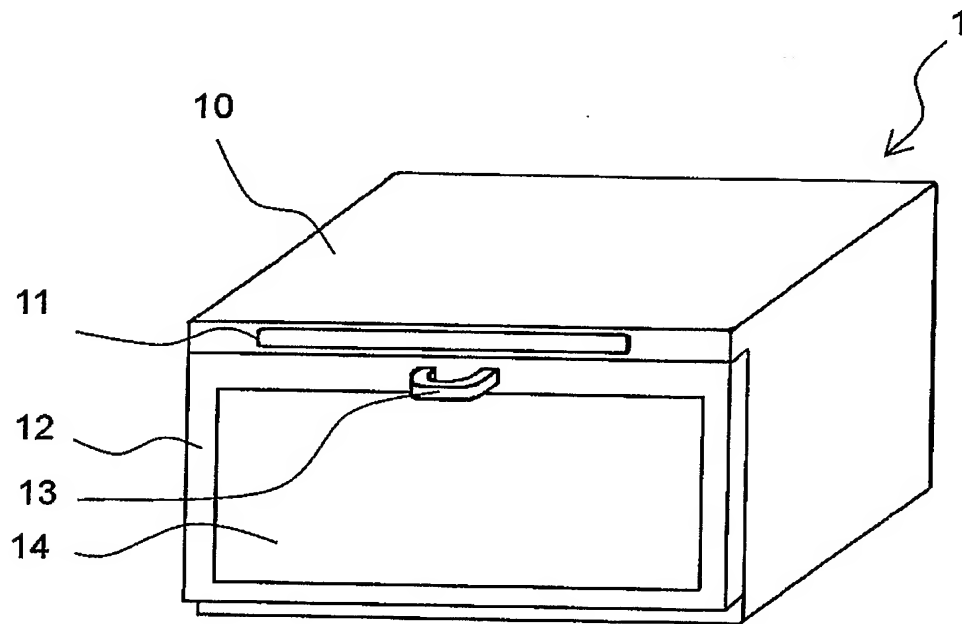
【0093】

- 1…蒸気調理装置
- 11…操作パネル
- 12…扉
- 13…ハンドル
- 14…窓
- 20…加熱室

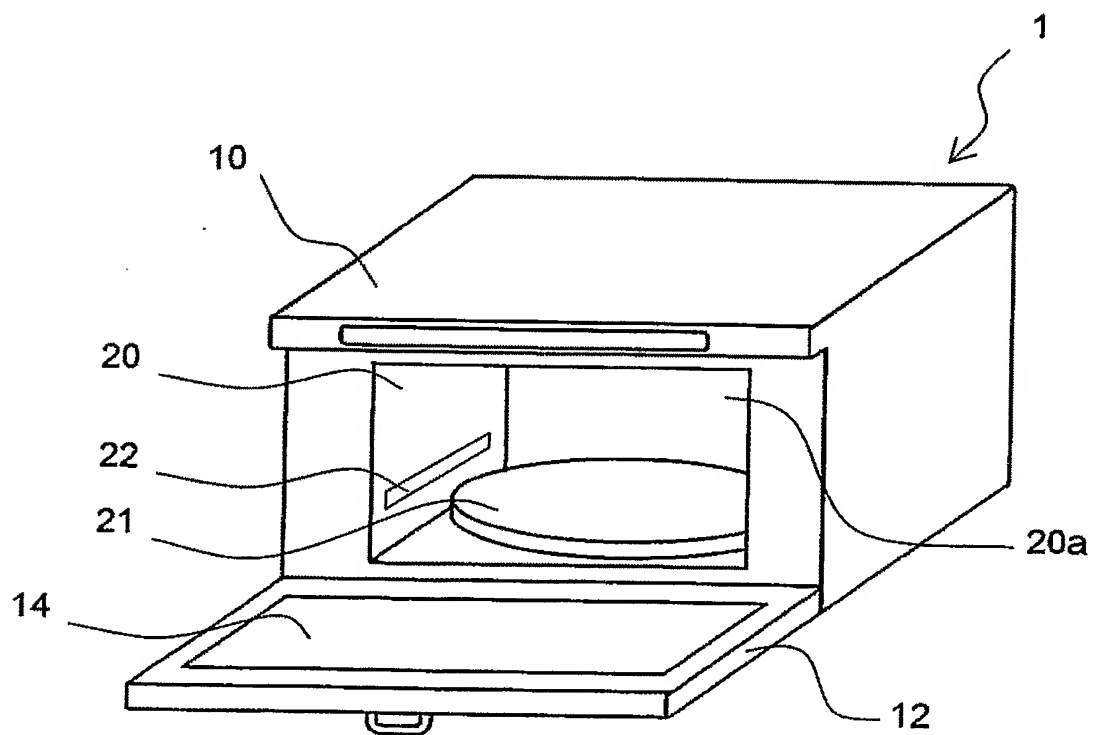
2 1 …受皿
2 2 …側面蒸気吹出口
2 3 …蒸気供給通路
2 4 …ラック
2 5 …吸込口
2 6 …ファンケーシング
2 7 …放出口
2 8 …送風ファン
3 0 …水タンク
3 1 …第 1 給水パイプ
3 2 …第 2 給水パイプ
3 3 …第 3 給水パイプ
3 4 …第 4 給水パイプ
3 5 …ポンプ
3 6 …水タンク用水位センサ
3 9 …補助タンク
4 0 …蒸気発生装置
4 1 …ポット
4 2 …ヒータ
4 2 A …第 1 蒸気発生ヒータ
4 2 A a …湾曲部
4 2 A b, 4 2 A c …直線部
4 2 B …第 2 蒸気発生ヒータ
4 2 B a …湾曲部
4 2 B b, 4 2 B c …直線部
4 3 …水位センサ
4 4 …蒸気吸引エジェクタ
4 7 …仕切板
4 8 …温度センサ
5 0, 1 5 0 …蒸気昇温装置
5 1, 1 5 1, 2 5 1 …皿形ケース
5 1 a …凹部
5 2, 1 5 2 …第 1 蒸気加熱ヒータ
5 2 a-1 …第 1 発熱部
5 2 a-2 …第 2 発熱部
5 2 a-3 …第 3 発熱部
5 2 b …第 1 非発熱部
5 2 c …第 2 非発熱部
5 3 …第 2 蒸気加熱ヒータ
5 3 a …発熱部
5 3 b, 5 3 c …非発熱部
5 6, 5 7 …放熱フィン
6 0 …外部循環路
6 1 …第 1 パイプ
6 2 …第 2 パイプ
6 3 …第 3 パイプ
6 4 …放出通路
6 5 …排気ダクト
6 6 …排気口
6 7 …排気通路

6 8 …ダンパ
 6 9 …ラジエータ
 7 0 …排水バルブ
 7 1 …排水パイプ
 7 2 …排水タンク
 8 0 …制御装置
 8 1 …温度センサ
 8 2 …湿度センサ
 9 1 …第 1 側壁
 9 2 A …第 2 側壁
 9 2 B …第 3 側壁
 9 3 A …第 4 側壁
 9 3 B …第 5 側壁
 9 4 A, 9 4 B, 9 4 C …蒸気供給管
 9 5 A, 9 5 B, 9 5 C …蒸気供給口
 9 6 …壁面
 1 0 1 A ~ 1 0 4 A, 1 0 1 B ~ 1 0 4 B …蒸気吹出口
 1 0 5 A, 1 0 5 B, 1 0 6 A, 1 0 6 B, 1 0 7 …R 部

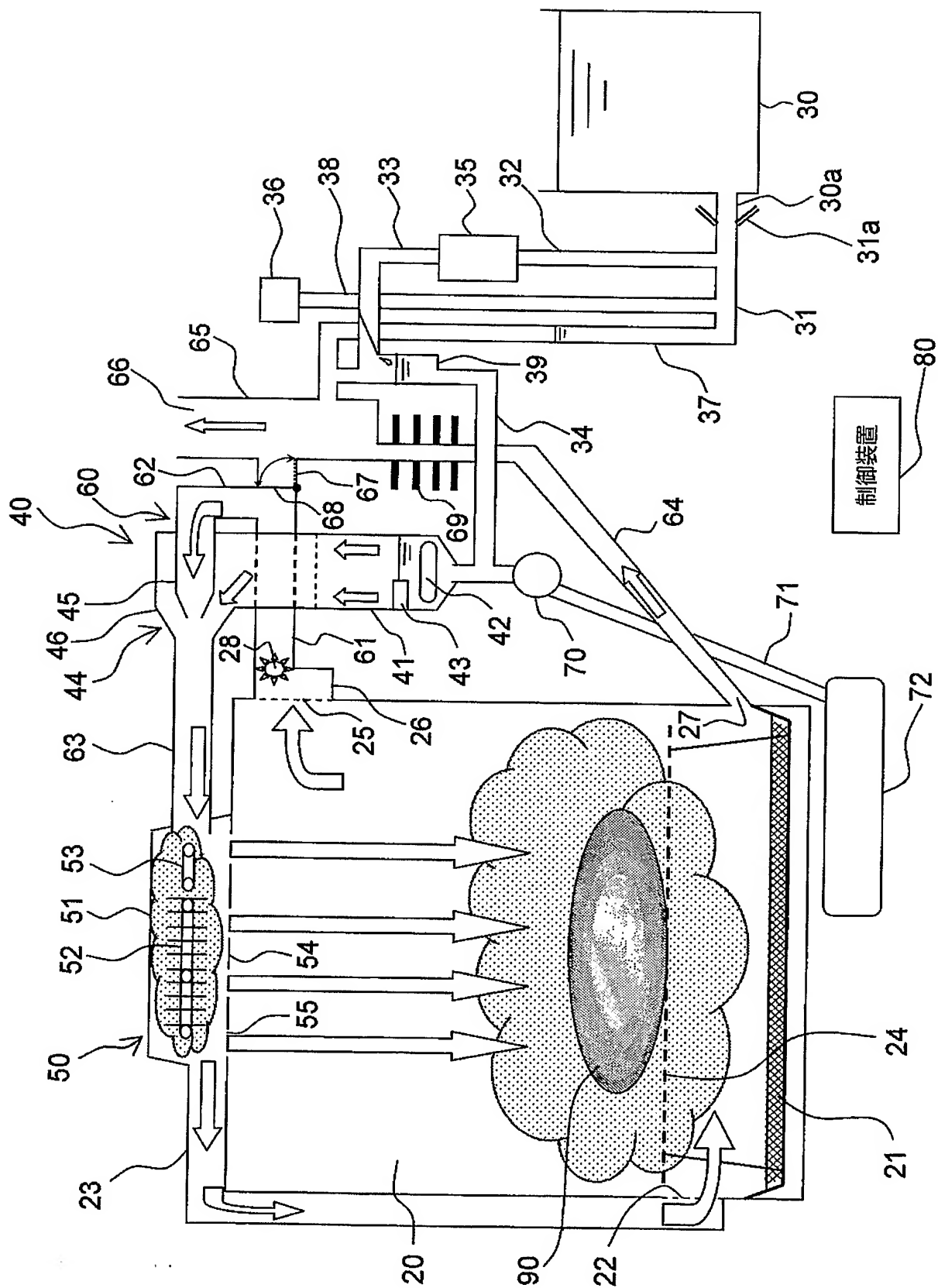
【書類名】 図面
【図 1】



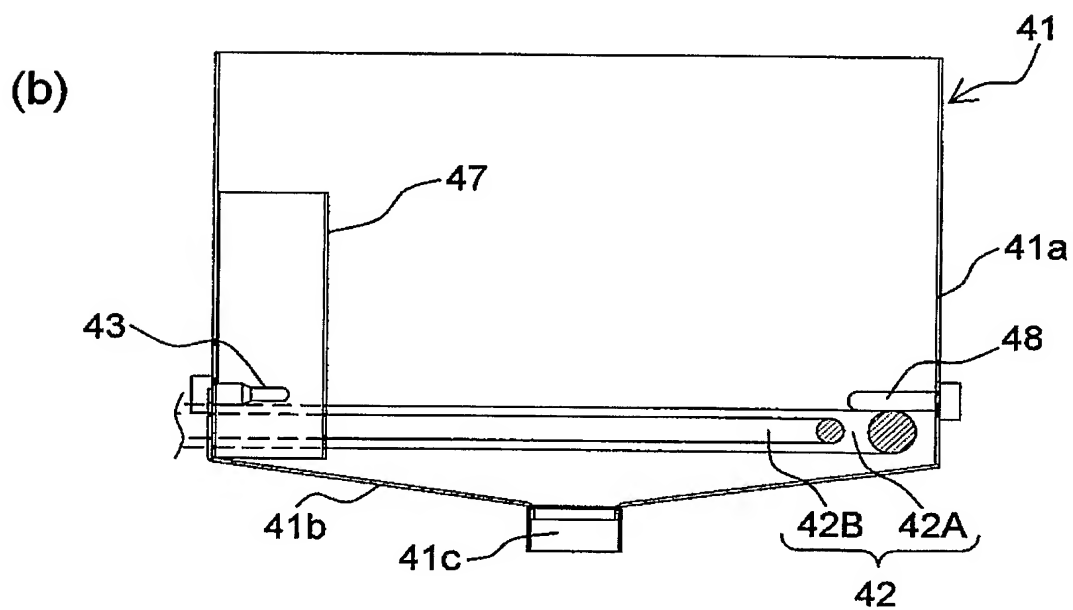
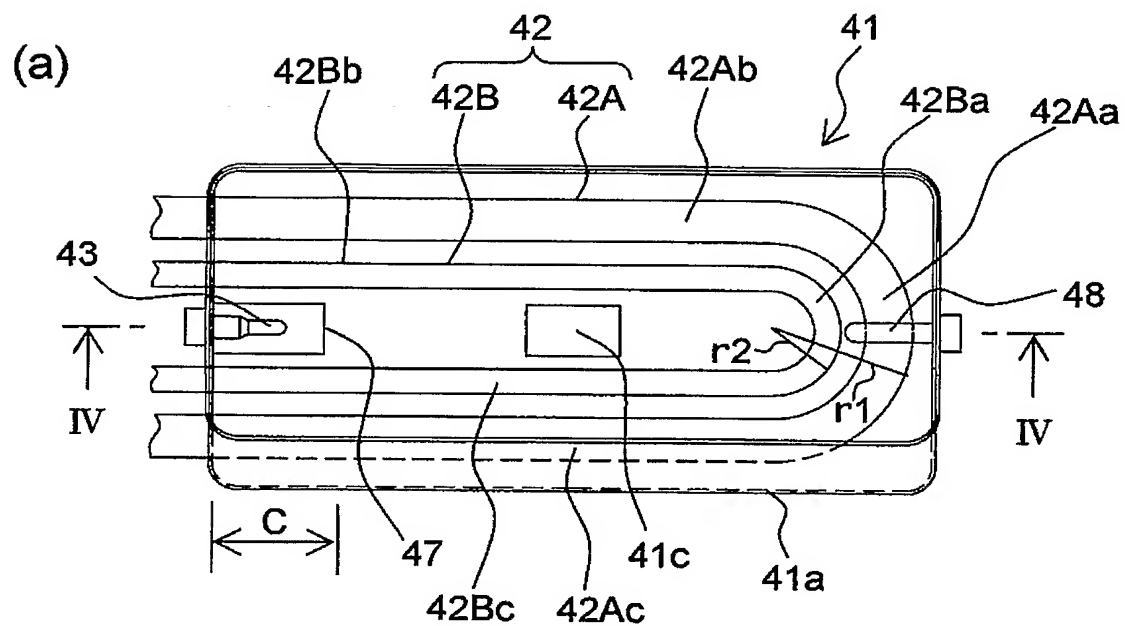
【図 2】



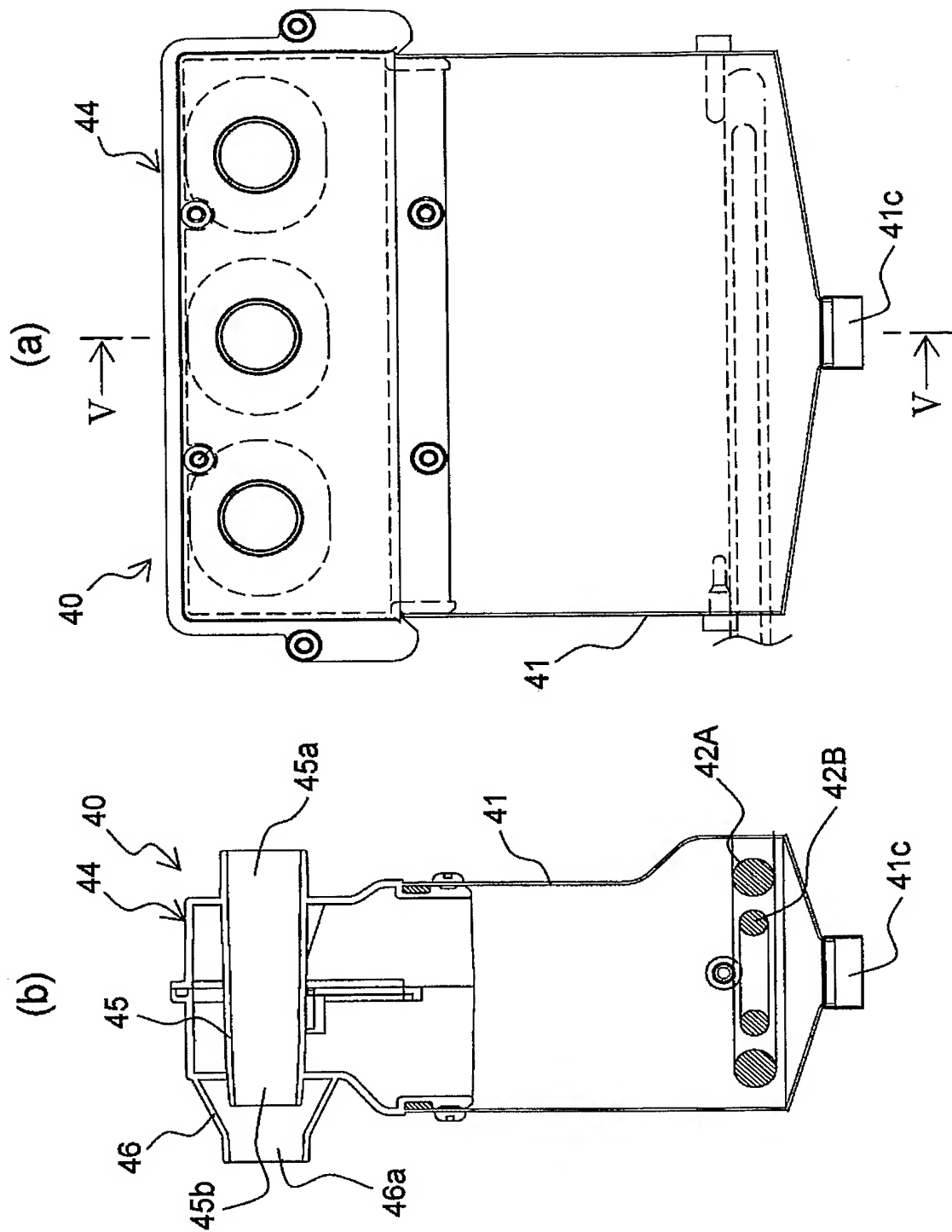
【図 3】



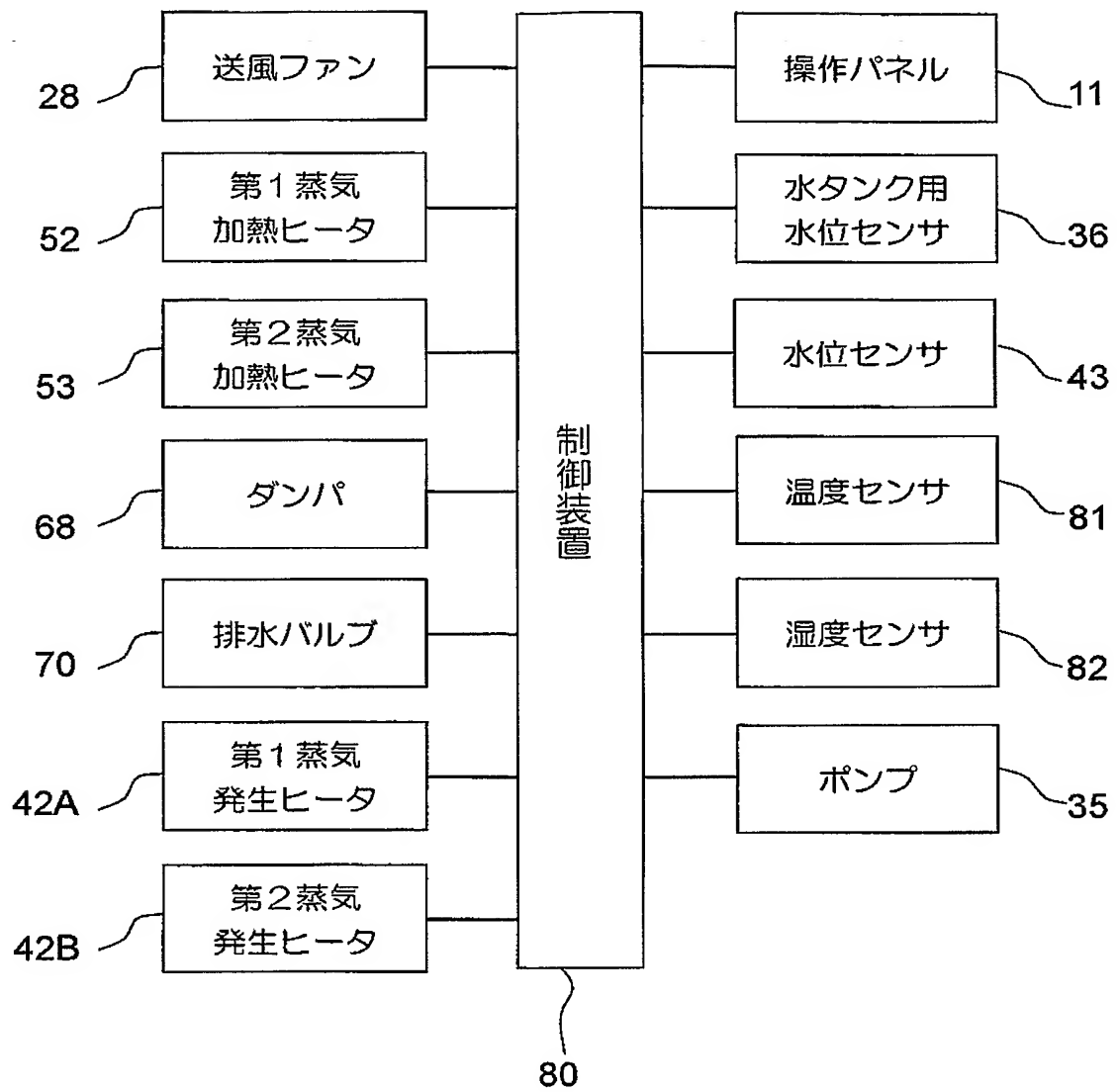
【図 4】



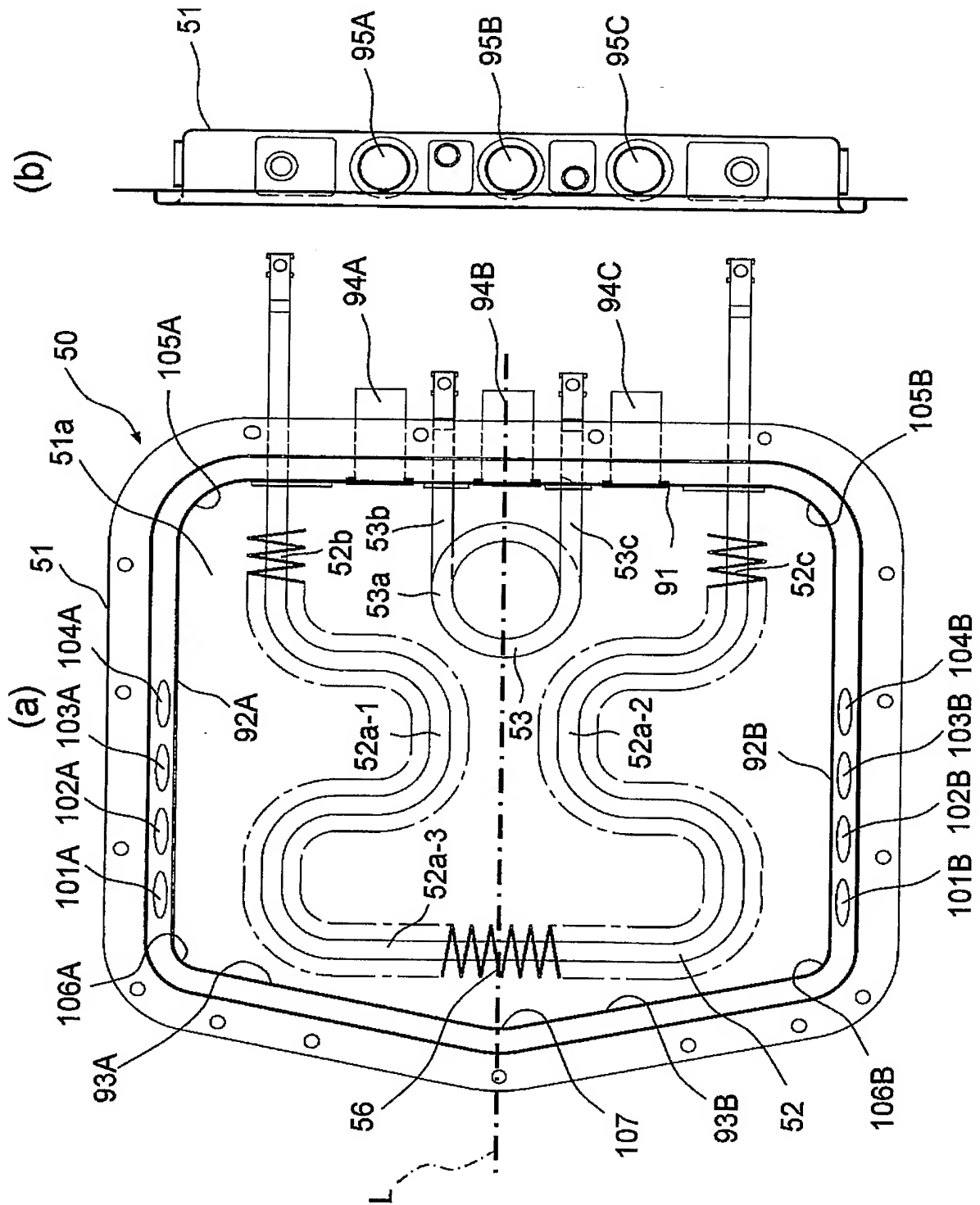
【図 5】



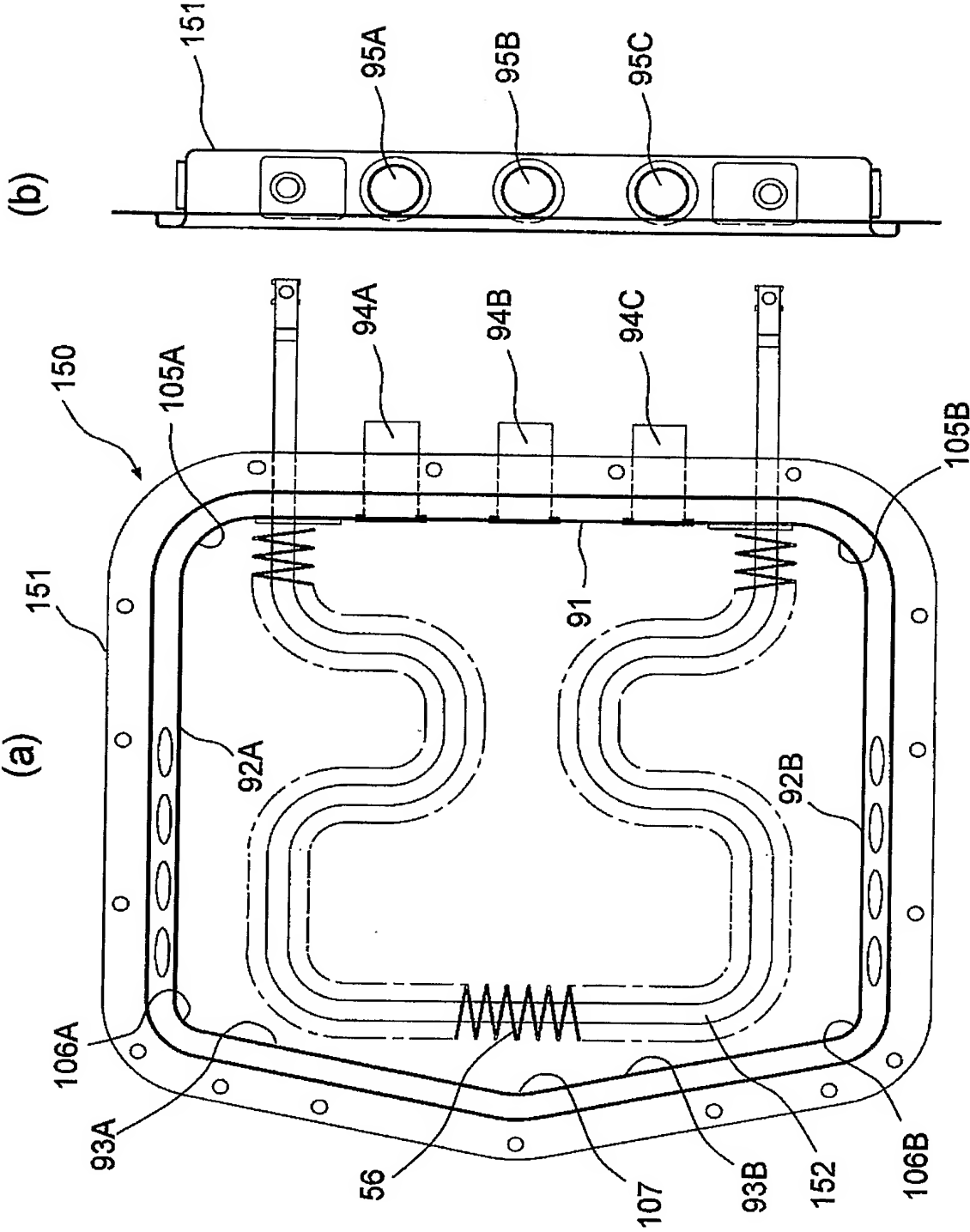
【図 6】



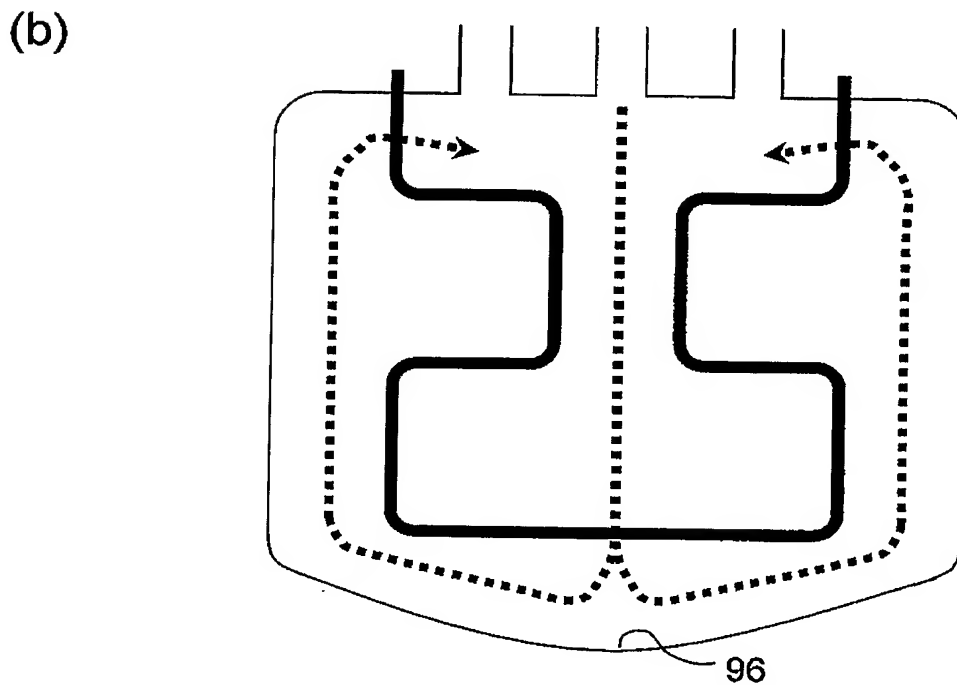
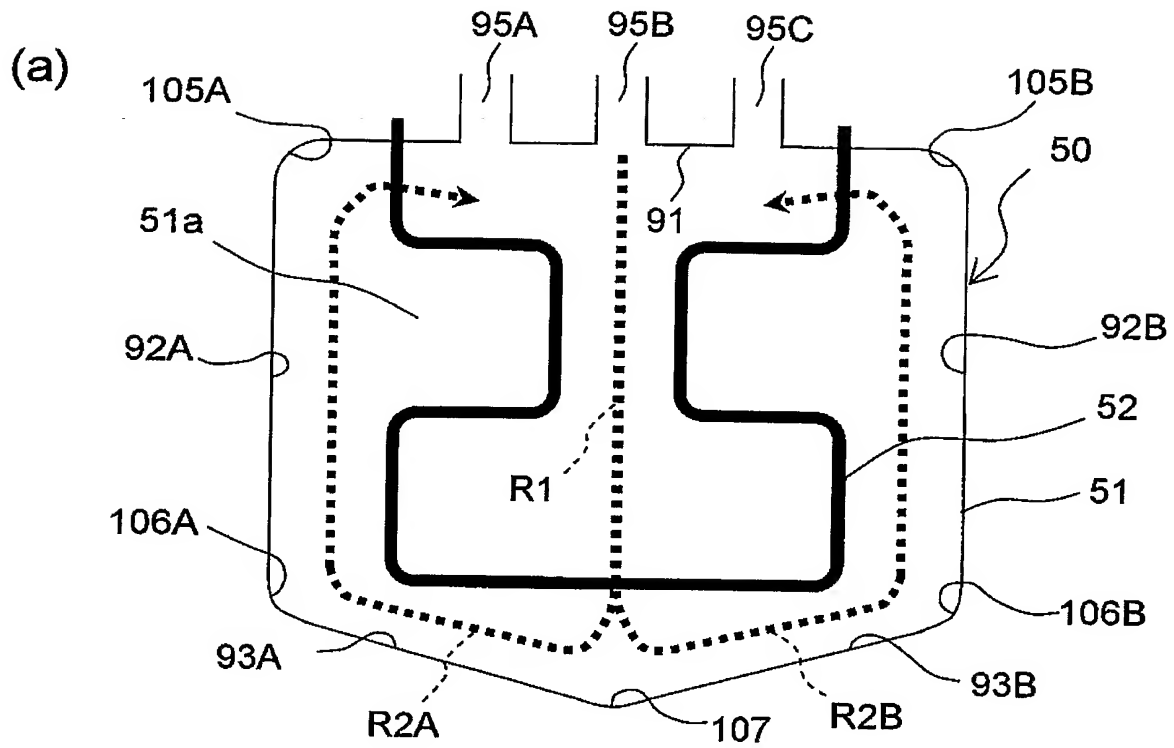
【図 7】



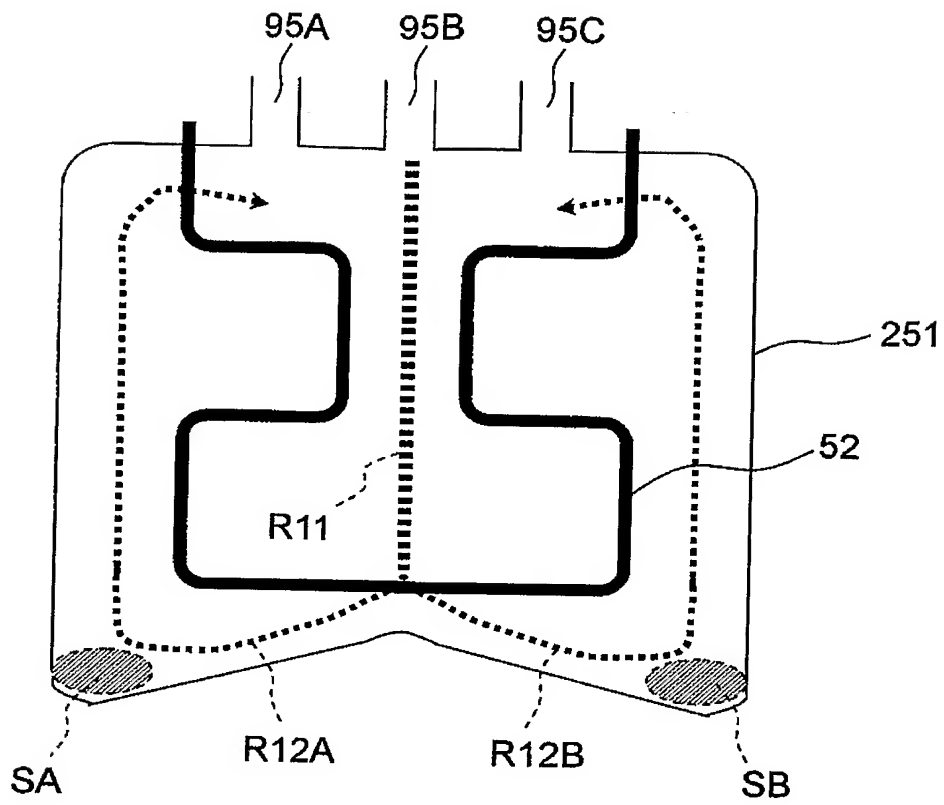
【図 8】



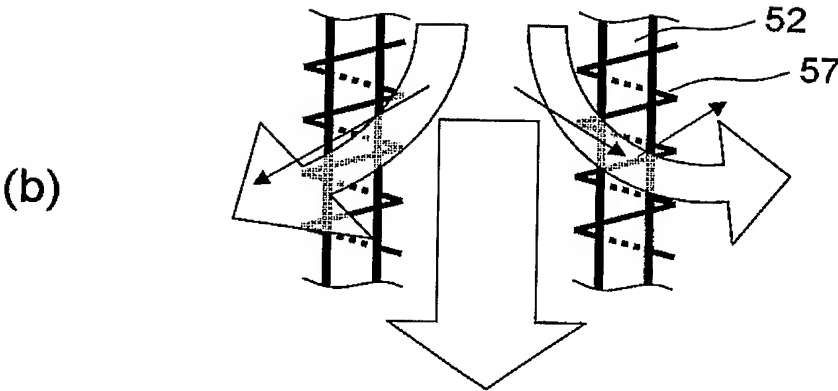
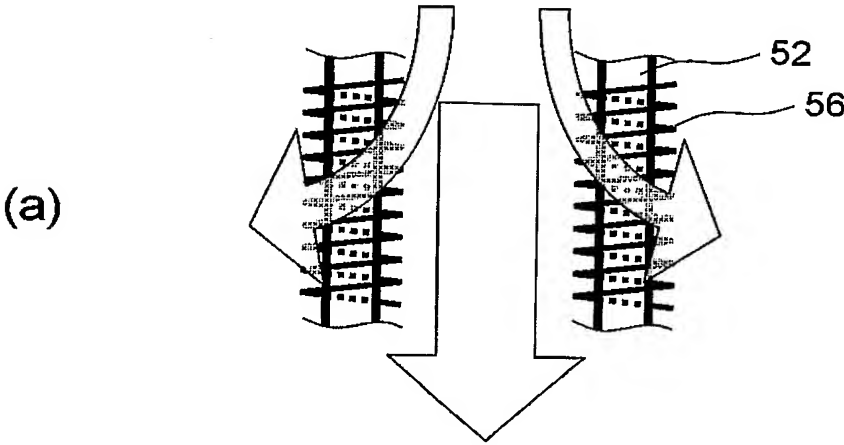
【図 9】



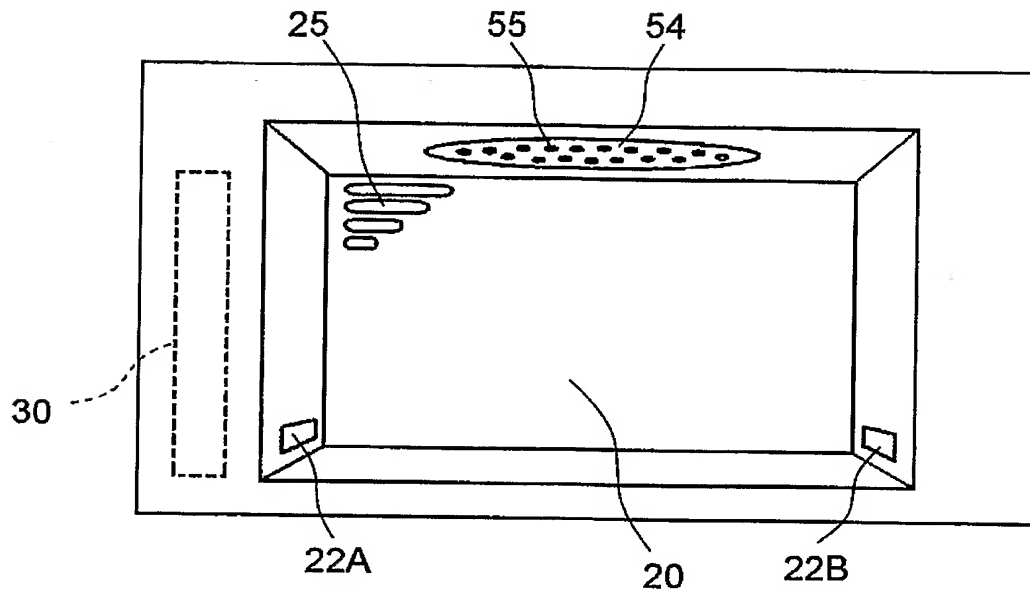
【図10】



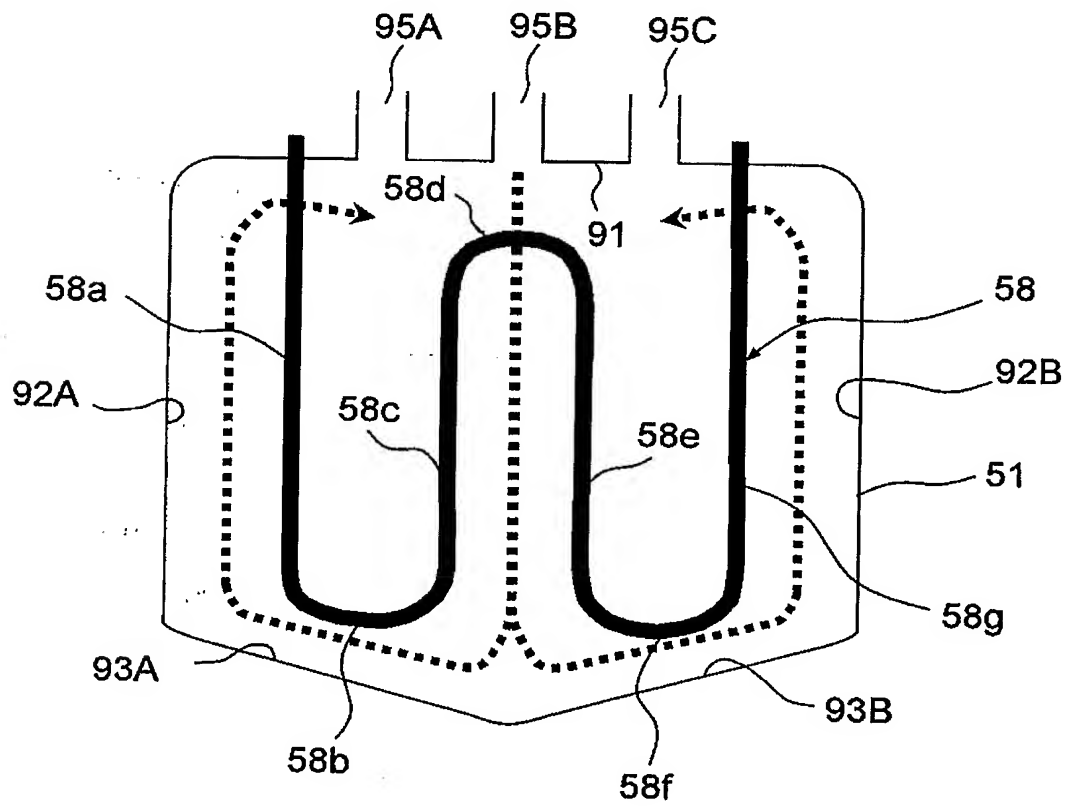
【図 11】



【図 12】



【図 13】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】加熱室内の温度分布を均一にでき、加熱ムラのない調理ができる蒸気調理器を提供する。

【解決手段】蒸気昇温装置50の皿形ケース51は、蒸気発生装置からの蒸気が第1側壁91に設けられた蒸気供給口95A～95Cから流入する凹部51aを有する。上記皿形ケース51の凹部51a内に、平面形状が上記中心線Lに対して略線対称になるように第1,第2蒸気加熱ヒータ52,53を配置する。上記皿形ケース51の凹部51aの蒸気供給口95A～95Cが設けられた第1側壁91に隣接する第2,第3側壁92A,92Bかつその第2,第3側壁92A,92Bの蒸気供給口95A～95Cと反対の側に、加熱室内に側方から蒸気を供給するため複数の蒸気吹出口101A～104A,101B～104Bに設ける。上記皿形ケース51を、凹部51aの開口を下側に向けて加熱室の天井パネルの蒸気吹出口上に配置する。

【選択図】図7

特願 2 0 0 4 - 0 5 3 6 5 6

ページ : 1/E

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 0 4 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号

氏 名

シャープ株式会社